(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-78956

(P2009-78956A)

(43) 公開日 平成21年4月16日 (2009.4.16)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
CO1B 31/0	12 (2006.01) CO1B	3 31/02 1 O 1 F 4 G 1 4 G
BO1J 23/2	7 45 (2006.01) BO1J	23/74 301M 4G169
BO1J 23/1	7 2 (2006.01) BO1J	23/72 M
BO1J 37/0)2 (2006.01) BO1J	37/02 3 O 1 P
BO1J 37/	1 8 (2006.01) BO1J	37/18
		審査請求 未請求 請求項の数 11 OL (全 20 頁)
(21) 出願番号	特願2007-250882 (P2007-250882)	(71) 出願人 000005821
(22) 出願日	平成19年9月27日 (2007.9.27)	パナソニック株式会社
		大阪府門真市大字門真1006番地
		(74)代理人 100097445
		弁理士 岩橋 文雄
		(74)代理人 100109667
		(74)代理人 100109151
		弁理士 永野 大介
		(72)発明者 浅利 琢磨
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下
		電器産業株式会社内
		ていた 大阪府門具市大子門具IOU6番地 松下
		電器座栗株式会位内

(54) 【発明の名称】カーボンナノチューブ複合体、これを用いたエネルギーデバイス及びカーボンナノチューブ複合体の製造方法

(57)【要約】

(19) **日本国特許庁(JP)**

【課題】アルミニウム基板上に高い比率で単層と二層が 混在したカーボンナノチューブ複合体を作製すること。 及びこれを電極材料に用いることで低抵抗かつ容量の大 きいエネルギーデバイスを提供すること。

【解決手段】カーボンナノチューブの触媒層を蒸着膜厚 0.5~1.0nmでアルミニウム基板上に形成し、触 媒粒子群を形成するために還元性ガス中で触媒基板を熱 処理し、還元性ガスと炭化水素ガスの混合ガス中で合成 温度570~660 で単層と二層が混在したカーボン ナノチューブ22をアルミニウムを含む基板21上に気 相成長させて、単層と二層が混在したカーボンナノチュ ーブ複合体を作製する。

【選択図】図1



(2)

【特許請求の範囲】 【請求項1】 アルミニウムを含む基板に、複数のカーボンナノチューブが接続されているカーボンナノ チューブ複合体であって、前記複数のカーボンナノチューブのうち、単層と二層とを合計 した割合が85~100%であるカーボンナノチューブ複合体。 【請求項2】 前 記 二 層 の カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 割 合 が 4 5 ~ 8 0 % で あ る 請 求 項 1 に 記 載 の カ ー ボ ン ナノチューブ複合体。 【請求項3】 10 前 記 単 層 の カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 割 合 が 5 0 % 以 上 で あ る 請 求 項 1 に 記 載 の カ ー ボ ン ナ ノチューブ複合体。 【請求項4】 前 記 カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ の 外 径 が 3 ~ 7 n m で あ る 請 求 項 1 に 記 載 の カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ーブ複合体。 【請求項5】 前 記 カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ が 、 前 記 基 板 に 対 し て 垂 直 配 向 し て い る 請 求 項 1 に 記 載 の カ ー ボンナノチューブ複合体。 【請求項6】 陽極と陰極からなる少なくとも一対の電極体を含むエネルギーデバイスであって、前記電 20 極体の少なくとも一方に、請求項1に記載のカーボンナノチューブ複合体を用いたエネル ギーデバイス。 【請求項7】 請求項6に記載のエネルギーデバイスを搭載している情報処理端末。 【請求項8】 請求項6に記載のエネルギーデバイスを搭載している輸送デバイス。 【請求項9】 アルミニウムを含む基板上に複数のカーボンナノチューブが接続されているカーボンナノ チューブ複合体の製造方法であって、 アルミニウムを含む基板上に、カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く触 30 媒層を膜厚0.5以上1.0nm以下で蒸着する工程と、 前記基板を還元性ガス中で熱処理することにより前記触媒を微粒子化する工程と、 還元性ガスと炭化水素ガスの混合ガス中にて合成温度600 以上660 未満でカーボ ンナノチューブを気相成長させる工程と、 を含むカーボンナノチューブ複合体の製造方法。 【請求項10】 アルミニウムを含む基板上に複数のカーボンナノチューブが接続されているカーボンナノ チューブ複合体の製造方法であって、 アルミニウムを含む基板上に、カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く触 媒層を膜厚1.0nmで蒸着する工程と、 40 前記基板を還元性ガス中で熱処理することにより触媒を微粒子化する工程と、 還元性ガスと炭化水素ガスの混合ガス中で合成温度570 以上600 未満でカーボン ナノチューブを気相成長させる工程と、 を含むカーボンナノチューブ複合体の製造方法。 【請求項11】 前 記 還 元 性 ガ ス が 、 水 素 を 含 む 請 求 項 9 ま た は 1 0 に 記 載 の カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 複 合 体 の製造方法。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

本発明は、カーボンナノチューブ複合体とその製造方法、これを用いたエネルギーデバ 50

イス、及びこれらを搭載した装置に関するものである。 【背景技術】

カーボンナノチューブは、優れた物性を有しており、その物性を利用して電界放出型電子放出素子、走査型プローブ顕微鏡(SPM)のプローブ、触媒、構造強化材料、放熱素子、電池の電極、トランジスタ材料、センサ材料など各種の応用が期待されている。 【0003】

(3)

カーボンナノチューブの製造方法としては、アーク放電法、レーザ蒸発法、熱CVD法 、プラズマCVD法などが知られている。これらの方法によって、一層のグラフェンシー ト(単原子層の二次元六員環ネット)のみからなる単層カーボンナノチューブ(SWNT)と、複数のグラフェンシートからなる多層カーボンナノチューブ(MWNT)とが製造 される。

【0004】

このグラフェンシートは、SP²結合によって6角形状につながった炭素原子によって 構成される。単層カーボンナノチューブは、1枚のグラフェンシートが筒状に巻かれた構 造を有する。単層カーボンナノチューブの直径は最小で0.4 nmであり、長さは現状で 最大3mmに達する。単層カーボンナノチューブは、直径、カイラル角(螺旋の角度)お よび螺旋方向(右巻きか左巻きか)の3つのパラメータによって規定される。該3つのパ ラメータの中でも、直径およびカイラル角によって、物性が金属と半導体との間で変化す るため、直径とカイラル角とを制御することが重要である。

【 0 0 0 5 】

カーボンナノチューブの製造方法の一例は、熱CVD法やプラズマCVD法を用いて、 触媒金属膜上にカーボンナノチューブを成長させる方法である。この方法では、例えば触 媒金属膜がCVD時の熱処理によって微粒子形状になり、その微粒子直径によってカーボ ンナノチューブの直径が変化すると言われている。この触媒微粒子を高密度に配置すると 、カーボンナノチューブ成長時にお互いが支えあうことで基板に対し垂直に成長した垂直 配向カーボンナノチューブ基板を作製することが可能である。

【 0 0 0 6 】

この垂直配向カーボンナノチューブ基板は、従来は基板にSi基板や石英基板などの非 金属基板を用いて、多層カーボンナノチューブを形成したものが多かった。例えば、Si 基板上に硝酸鉄のエタノール溶液をスピンコートし、熱処理により酸化鉄クラスターを形 成した後、アセチレンを用いて合成温度650~750 で多層カーボンナノチューブを 形成している(例えば、非特許文献1)。しかしながら、この方法では、多層カーボンナ ノチューブで直径20~30nmの太い径のものしか作製することができなかった。 【0007】

また、金属基板上ではカーボンナノチューブの原料ガスである炭化水素ガスなどの分解 温度より極めて高い融点を持つ金属を用いてカーボンナノチューブを合成している例があ る。例えば、キシレン中フェロセン溶液を用いたinconel金属(Ni:Cr:Fe = 7 2 : 1 6 : 8)上に合成温度 7 7 0 で多層カーボンナノチューブを合成する(例え ば、非特許文献 2)。しかしながら、この方法では、多層カーボンナノチューブの直径 1 0~70nmと分布が非常に大きくなっており、直径分布や直径の制御することができな かった。

[0008]

一方、アルミニウム基板上に650 で多層カーボンナノチューブを形成することも報告されている(例えば、非特許文献3)。しかしながら、この方法では、硝酸鉄の溶液を 非常に薄くしたにもかかわらず、多層カーボンナノチューブの直径が約20nmであり、 走査電子顕微鏡写真を見ても基板上の一部分からしか成長していない。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

ところで、近年の大きな進展として、単層カーボンナノチューブを基板に対し垂直配向 に形成することが可能になっている。例えば、Co-Mo酢酸溶液を石英基板上にディッ

10

30

プコートし、合成温度800 でエタノールを炭素供給源として基板垂直配向な単層カー ボンナノチューブを合成している(例えば、非特許文献4)。しかしながら、この方法で は、欠陥の少ない単層カーボンナノチューブが得られているが、エタノールの分解温度が 800 以上であるため、融点がおよそ660 であるアルミニウムを基板材料として用 いることはできなかった。

[0010]

また同様に大きな進展として、ニッケル基板(融点1,455)、鉄基板(融点1, 534)、ステンレス基板(融点1,300~1,500)上に単層もしくは二層カ ーボンナノチューブを基板に対し垂直配向に形成できることも報告されている(例えば、 非特許文献5)。これらの金属基板はすべて融点が1,000 以上の金属であり、使用 している熱CVDにおいて炭素供給ガスであるエチレンガス分解温度として750 が必 要であるため、融点がおよそ660 であるアルミニウムを基板材料として用いることは できなかった。

[0011]

また、単層カーボンナノチューブのみ、または単層及び二層カーボンナノチューブを選 択的に合成する手法としては、以下の先行技術がある。

【 0 0 1 2 】

遷移金属酸化物微粒子が形成されたシリコン基板を有機液体中に浸漬し、カーボンナノ チューブの合成温度で加熱する(例えば、特許文献1)。遷移金属の膜厚を6nm以下に 制御すると、単層カーボンナノチューブのみを合成でき、同6nm以上で15nm以下に 制御すると、単層及び二層カーボンナノチューブのみを合成できるとしている。この手法 は、有機液体中での合成であり、またシリコン基板上で合成しているため、アルミニウム 基板の融点を超える800 での合成であり、同手法では融点がおよそ660 であるア ルミニウムを基板材料とする場合に適用することは出来ない。

【 0 0 1 3 】

他に二層カーボンナノチューブのみを選択的に合成する手法として、以下の先行技術が ある。Si基板上にTiNからなるバッファ層を生成し、パルスアークプラズマを用いて 粒径5nm以下のCoナノ粒子を堆積させ、合成させると、外径が5nm以下の多数の二 層カーボンナノチューブを相互に平行に生成できるとしている(例えば、特許文献2)。 この場合も合成温度700 とアルミニウム融点より高温であり、また二層カーボンナノ チューブの収率が記載されておらず、当該特許文献2記載の図11からその収率を算出す ると50%以下にとどまると推測され、当発明の二層カーボンナノチューブの収率範囲を 下回っている。

[0014]

またエネルギーデバイスである電気二重層キャパシタにおいて、現在は集電体であるア ルミニウム箔上に活性炭ペースト電極を形成しているが、数多くの活性炭粒子と結着剤を 混ぜて電極形成するためにアルミニウム箔との界面で抵抗が大きくなることが問題であっ た。そこで、活性炭容量を上回る容量をもつ材料開発が必要になっている。 【非特許文献1】Ch. Emmenegger, Carbon, Volume 4 0, Issue 8, 2002, 1339-1344 【非特許文献 2】S. TALAPATRA et al., nature nano technology Nov 2006 p112-116 【非特許文献3】Ch. Emmenegger, Applied Surface Science, 162-163, 2000, 452-456 【非特許文献4】S. Maruyama, Chem. Phys. Lett., 2005, 403, 4-6, 320-323. 【非特許文献 5】 T. Hiraoka et al., J. Am. Chem. S oc. 128, 13338-13339, (2006) 【特許文献1】特開2005-314161号公報 【特許文献 2 】特開 2 0 0 6 - 3 1 5 8 8 1 号公報

10

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0015】

以上のように、現在報告されている手法では、アルミニウムを含む基板上に、単層及び 二層カーボンナノチューブを高収率に合成することはできなかった。

【0016】

本発明は、アルミニウム基板上に高い比率で単層と二層のカーボンナノチューブが混在 したカーボンナノチューブ複合体及びその製造方法を提供すること、このカーボンナノチ ューブ複合体を電極材料に用いることで低抵抗かつ容量の大きいエネルギーデバイスを提 供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、エネルギーデバイスである電気二重層キャパシタにおいて、カーボンナ ノチューブ電極が活性炭電極よりも、電気化学容量に対応する表面積が拡大するため容量 拡大に有望であると考え、重量当たりの表面積が大きくなる単層および二層カーボンナノ チューブを用いることが特に有望であると考えた。また、抵抗低減のためにアルミニウム 箔から直接カーボンナノチューブ電極を成長させることで、界面抵抗を低減できると考え た。アルミニウムを含む基板上に単層及び二層のカーボンナノチューブを高収率で合成す るには、アルミニウムの融点である660 以下で合成することが不可欠である。本発明 において、触媒蒸着膜厚と合成温度を調整することにより、アルミニウム基板上に非常に 高い収率で単層及び二層カーボンナノチューブを合成することが可能になった。 【0018】

20

10

すなわち第一の発明は、アルミニウムを含む基板に、複数のカーボンナノチューブが接続されているカーボンナノチューブ複合体であって、前記複数のカーボンナノチューブの うち、一層と二層とを合計した割合が85~100%であるカーボンナノチューブ複合体 である。

[0019]

本発明に係るカーボンナノチューブを電極材料に用いることで、従来の活性炭よりも大きな容量を有するエネルギーデバイスを実現することができる。また、アルミニウム箔から直接カーボンナノチューブ電極を成長させることで、これらの界面抵抗を低減することができる。

[0020]

第二の発明は、アルミニウムを含む基板上に複数のカーボンナノチューブが接続されて いるカーボンナノチューブ複合体の製造方法であって、アルミニウムを含むとする基板上 に、カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く触媒層を膜厚0.5以上1. 0nm以下で蒸着する工程と、前記基板を還元性ガス中で熱処理することにより前記触媒 を微粒子化する工程と、還元性ガスと炭化水素ガスの混合ガス中にて合成温度600 上660 未満でカーボンナノチューブを気相成長させる工程とを含むカーボンナノチュ ーブ複合体の製造方法である。

[0021]

第三の発明は、アルミニウムを含む基板上に複数のカーボンナノチューブが接続されて いるカーボンナノチューブ複合体の製造方法であって、アルミニウムを主成分とする基板 上に、カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く触媒層を膜厚1.0nmで 蒸着する工程と、前記基板を還元性ガス中で熱処理することにより触媒を微粒子化する工 程と、還元性ガスと炭化水素ガスの混合ガス中で合成温度570 以上600 未満でカ ーボンナノチューブを気相成長させる工程とを含むカーボンナノチューブ複合体の製造方 法である。

【0022】

これらの製造方法により、アルミニウムを含む基板上に、一層と二層とを合計した割合が85~100%である複数のカーボンナノチューブをアルミニウムを含む基板上に合成

40

することができる。

【発明の効果】

【0023】

重量当たりの表面積が大きくなる単層及び二層カーボンナノチューブの割合が高い本発 明に係るカーボンナノチューブ複合体を電極材料に用いることで、従来の活性炭よりも大 きな容量を有するエネルギーデバイスを実現することができる。また、アルミニウム箔か ら直接カーボンナノチューブ電極を成長させることで、それらの界面抵抗を低減すること ができる。本発明の製造方法により、アルミニウム基板上に高い比率で単層と二層が混在 したカーボンナノチューブ/アルミニウム基板を作製することが可能になる。

(6)

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。本発明の 以下に示す実施の形態及び各図面は例示を目的とし、本発明はこれらに限定されるもので はない。

【0025】

図1に、本発明に係るカーボンナノチューブ複合体を示す。カーボンナノチューブ複合体は、アルミニウムを含む基板22とカーボンナノチューブ21とが電気的に接続される ことにより形成されてなる。基板22は、アルミニウムを主成分として形成されている。 カーボンナノチューブ21は、基板22に一端が接続され、基板22の全面に形成されて いる。

[0026]

ここで、複数のカーボンナノチューブ21のうち、一層と二層のカーボンナノチューブ とを合計した割合が85~100%である。さらに、二層のカーボンナノチューブの割合 が45~80%であり、単層のカーボンナノチューブの割合が50%以上を占める。後述 するように、重量当たりの表面積が大きくなる単層及び二層カーボンナノチューブの割合 が高いカーボンナノチューブ複合体を電極材料に用いることで、従来の活性炭よりも大き な容量を有するエネルギーデバイスを実現することができる。

なお、層数分布評価は、Alを含む基板上に作成されたカーボンナノチューブの一部を 剥離してトルエン中に超音波分散させ透過電子顕微鏡(TEM)により実施した。具体的 には、100本のCNT層数を計測し一層及び二層の分布を取ったものである。ここで、 収率とは、対象とするカーボンナノチューブが存在する確率を意味する。 【0028】

カーボンナノチューブ21の平均直径は約0.1~100nmの範囲に収まるが、本発 明に係るカーボンナノチューブ複合体を各種エネルギーデバイスに用いた場合に、イオン 半径0.074nmのリチウムイオンや、イオン半径約0.5nmの電解質イオンがその 内部に侵入することを考えると、0.1~10nmの範囲が好ましい。さらに好ましくは 、3~7nmの範囲である。なお、このカーボンナノチューブ21の平均直径は、透過電 子顕微鏡画像により測定した。

[0029]

ここで、カーボンナノチューブ21間の距離は短いほうが、高密度となるため好ましいが、電解液中の電解質イオンが移動するのに十分な距離が必要である。 【0030】

また、本発明に係る複数のカーボンナノチューブ21は、アルミニウムを含む基板22 に、垂直配向するものが好ましい。これによって電極活物質の表面積が増大し、エネルギ ーデバイスのエネルギー密度が向上するからである。ここで「垂直配向」とは、カーボン ナノチューブ21の一端がアルミニウム基板22に接続されており、他端や側面は導電体 から実質的に遊離している状態を意味する。

【0031】

また、積層型や捲回型のエネルギーデバイスを作製する際に、体積当りのエネルギー密 50

10

40

度を大きくするには、アルミニウムを含む基板の両面に複数のカーボンナノチューブが接続されていると望ましい。これにより、アルミニウムを含む基板両面が複数のカーボンナ ノチューブで被覆されることにより漏れ電流を減少でき、同時に、アルミニウムを含む基 板1枚当りの活物質カーボンナノチューブ量を多くすることが出来る。その場合の製造方 法としては、アルミニウム基板の両面に触媒層を形成し、その両側にプラズマ形成してカ ーボンナノチューブを合成することで可能になる。

【 0 0 3 2 】

本発明に係るカーボンナノチューブ複合体は、電気二重層キャパシタ、電気化学キャパ シタ、リチウムイオンキャパシタ、リチウムイオン二次電池、有機電池等を含むエネルギ ー蓄積デバイス全般において適用可能なものである。すなわち、電極体がアルミニウムを 主成分とする基板上にカーボンナノチューブが形成されている限り、適用できるエネルギ ーデバイスは特に限定されない。

以下、本発明に係るカーボンナノチューブ複合体が各々のエネルギーデバイスに適用される際の様態について述べる。

リチウムイオン二次電池では、通常、正極としてコバルト酸リチウム等のリチウム酸化 金属、シリコン化合物、又は、リチウム金属が用いられ、負極としてグラファイト等が用 いられている。この場合、負極に用いられているグラファイトの代わりに同じグラフェン 構造を持つカーボンナノチューブを使用し、正極では活物質の担持材料としてカーボンナ ノチューブを用いることが可能である。

[0035]

リチウムイオンキャパシタでは、正極として活性炭が、負極としてグラファイトが提案 されていることから、正負極ともに、カーボンナノチューブを用いることが可能である。 【0036】

有機電池では、電極の少なくとも一方の活物質に有機材料を用いることが提案されてお り、当該有機材料の担持材料としてカーボンナノチューブを用いることが可能である。 【0037】

上述のとおり本発明においては、カーボンナノチューブそのものが電極活物質として機能するものであってもよいし、他の電極活物質のための担持材料として機能するものであ ³⁰ってもよい。

【0038】

図2(1)に、本発明に係るカーボンナノチューブ複合体を用いた円筒型エネルギー蓄 積デバイス10の外観図を示す。

【0039】

円筒型エネルギー蓄積デバイス10は、円筒形状をした、アルミニウムやS U S 製の金属製容器9を備えており、その中に電解液(図示せず)が収容され、封口体11に よってその上面が閉じられている。金属製容器9内に、帯状の正電極4及び負電極5が収 納されている。正電極4と負電極5は、それぞれ上電極4aと下電極4b、上電極5aと 下電極5bにより構成されている。正電極4と負電極5は、さらに2枚のセパレータ3が 積層されて捲回され、電解液中に浸されている。正極集電体2aと負極集電体2bには、 それぞれ正極リード12aと負極リード12bが接続され、封口体11を通過して金属製 容器9外に引き出されている。

[0040]

図(2)に、図2(1)中に領域Aで示した円筒型エネルギー蓄積デバイス10の電極 部分の構成図を示す。正電極4は、上電極4a/正極集電体2a/下電極4bの構成とな っている。また、負電極5は、上電極5a/負極集電体2b/下電極5bの構成となって いる。正電極4の金属製容器9側の表面と、正電極4と負電極5の間にはセパレータ3が 配置されている。

【0041】

40

10

ここでは、エネルギー蓄積デバイスの円筒型構造について説明したが、コイン型構造や 積層型構造でも本発明の効果になんら影響は与えない。

[0 0 4 2]

本発明において、電気二重層キャパシタとして機能させる場合は、正電極4と負電極5 はともにカーボンナノチューブを主体とする材料、集電体2はアルミニウムを主体とする 材料から構成する。また、リチウムイオン二次電池として機能させる場合は、高いエネル ギー密度が必要となるため、例えば、正電極4の活物質にコバルト酸リチウム等のリチウ ム酸化金属、負電極5の活物質にカーボンナノチューブを主体とする材料を用いることが できる。

【0043】

電解液は、デバイスの種類に応じた材料を選ぶことが必要である。まず、溶媒は使用電 圧範囲によって電気化学的に分解しないような電位窓を有することが必要であり、一般に プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、エチルメチルカーボネート、又はこれ らの混合溶媒を用いることができるが、リフロー対応が必要な場合は、リフロー時に電解 液が沸騰しないように、例えばスルフォラン等の高沸点溶媒を用いることが必要である。 また、電解質としては、電気二重層キャパシタ用として、例えば、テトラエチルアンモニ ウムテトラフルオロボレートを用いることができ、リチウムイオン二次電池用として、例 えば、リチウムペンタフルオロフォスフェートを用いることができる。

【0044】

セパレータ3には、デバイスの種類に依存せず、ポリプロピレン等を用いることができ ²⁰ るが、例えば、リフロー対応が必要な場合は、耐熱性のある材料、例えば、セルロース系 の材料を用いることが必要である。

【0045】

以下、カーボンナノチューブ21の一端を接続させる基板22の材料として、従来よく 用いられてきたシリコンではなく、アルミニウムを用いた理由を述べる。 【0046】

一般に、正極集電体2aと負極集電体2bは、捲回する必要がある。そのため、集電体2は、ある程度の柔軟性を備えることが必要である。すなわち、基板を構成する材料として硬度が高いシリコンを用いた場合、捲回することができない。これに対して、アルミニウムの場合硬度が低く捲回することができる。また、シリコンは、アルミニウムよりも導電性が低い。加えて、印加した電極電圧により集電体金属イオンの流出などが起きる可能性があるため、イオン化傾向に応じた最適な材料を選択する必要がある。また、エネルギーデバイスに使用するには材料が安価であることが重要であり、アルミニウムはその観点で現状最も最適な材料である。すなわち、基板を構成する材料としてシリコンを用いた場合、イオン化傾向が低いアルミニウムを用いた場合、イオン化するおそれはない。

【 0 0 4 7 】

(本実施の形態に係るカーボンナノチューブ複合体の製造方法)

以下、本実施の形態に係るカーボンナノチューブ複合体の製造方法について説明する。 【0048】

工程(1) アルミニウムを構成材料とする基板を用意し、この上に、電子ビーム蒸着 により触媒金属を形成する。本実施の形態においては、Fe/A1/Feの金属層を用い たが、触媒金属としてニッケル、鉄、コバルト、銅、イットリウム、ロジウム、パラジウ ム、クロム、亜鉛、シリコン、硫黄、金、ボロン等が挙げられる。この材料選択はカーボ ンナノチューブとその合成方法によって決定される。このとき、触媒層の膜厚は、0.5 以上1.0nm以下となるように制御する。

【0049】

工程(2) 先端放電型プラズマCVD装置内において、真空引きした後、H2ガスとCH4ガスの混合ガスを流入させ、抵抗加熱によりアニールを実施し触媒微粒子を形成する。

10

[0050]

工程(3) 還元性ガスと炭化水素ガスの混合ガス中にて化学的気相成長法によりカー ボンナノチューブ成長を行なう。触媒層の膜厚0.5以上1.0nm未満の場合、カーボ ンナノチューブの合成温度は、600 以上660 未満に制御する。また、触媒層の膜 厚1.0nmの場合、カーボンナノチューブの合成温度は、570 以上600 以下に 制御する。合成条件によっては触媒金属がカーボンナノチューブの先端に移動することも あるが、その場合でもカーボンナノチューブと導電体の電気的接続は保持されている。な お、触媒金属粒子径と、合成されるカーボンナノチューブ径の間には相関関係があると一 般的に言われている。

【0051】

以下、本発明の具体的な実施例に基づいて説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。表1に、実施例1~6、比較例1、2の実験条件と実験結果を示す。 【0052】

【表1】

	基板	基板厚み (µm)	触媒Fe 蒸着厚 み (nm)	触媒ア ニール 温度 (℃)	CNT合 成温度 (℃)	CNT厚 (μm)	CNT外 径平均 (nm)	DWNT収 率 (%)	SWNT 収率 (%)	SWNT + DWNT 収率 (%)	容量 (F/g)	容量増減 率 (%)
実施例1	AI	300	0.5	620	630	136	3.99	56	40	96	97	59
実施例2	AI	300	1.0	620	630	162	4.29	78	8	86	なし	—
実施例3	Al	300	0.5	620	600	85	3.81	44	52	96	74	2 1
実施例4	Al	300	1.0	620	600	153	4.10	79	12	91	なし	-
実施例5	AI	300	1.0	620	570	170	4.14	74	16	90	58	-5
実施例6	Cu	10	0.5	620	640	3	-	1	I	Ι	なし	-
比較例1	AI	300	0.5	620	570	成長せず	1	1	1	—	_	_
比較例2	活性炭/AI	-	-	-	-	-	-	-	ł	-	61	-

【0053】

(実施例1)

実施例1に係るカーボンナノチューブ複合体は、以下の方法により作成した。A1を含む基板(厚さ300µm、基板表面粗さ(最大1212nm、平均212nm))に、電子ビーム蒸着によりA1/Fe/A1(=0.5/0.5/5nm)を形成した。これら金属層中のFeのみがCNT成長の触媒として機能し、下層A1は触媒Feの保持層として、上層A1は触媒Feの酸化防止層としての機能を期待している。この電子ビーム蒸着プロセスの手順として、cA1 5nmを形成後に電子ビーム蒸着装置チャンパからサンプルを取り出し、3日以上の空気中自然酸化を行い、自然酸化膜A12O3を形成した。その後再度、電子ビーム蒸着装置チャンパ内にサンプルを入れ、上層A1/Fe(=0.5/0.5nm)を自然酸化膜A12O3上部に形成した。次に、先端放電型プラズマCVD装置内に上記サンプルをMo製ホルダ上に配置し、初期真空度<3×10-4Paまで真空引きした後、H2ガス45sccmとCH4ガス5sccmの混合ガスを20Torr圧下で流入させ、抵抗加熱により620 アニールを5min間実施し触媒Fe微粒子を形成した。続けて、2.45GHzマイクロ波を60W印加し、630 で30min間のCNT成長を実施した。

[0054]

先端放電型プラズマCVD装置は装置チャンバ内にタングステン製アンテナを設置し、 10mm径のプラズマボールをそのアンテナ先端に発生させている。基板ホルダはアンテ ナ先端から5cm程度離れているため、アンテナ先端に発生したプラズマボールからはラ ジカルのみが基板に到達しCNT成長を促すと同時に、イオンの到達を大幅に減少できる ため成長したCNTへのダメージを減少させ、かつ触媒活性を持続させ、高純度CNTを 取得することが本装置は可能である。 20

[0055]

上記装置からA1基板上CNTサンプルを取り出し、その一部を剥離してトルエン中に 超音波分散させ透過電子顕微鏡(TEM)による層数分布評価を実施した。層数分布評価 は、 1 0 0 本のCNT層数を計測し分布を取ったもので、 DWNT収率は二層CNTが存 在する確立を示す。また、A1基板上CNTサンプルをSEMにより断面撮影することで 成長したCNT厚みを計測した。

[0056]

次に、A1基板上CNTサンプルの電気化学評価を下記の方法により実施した。電気化 学 測 定 と し て 、 サ イ ク リ ッ ク ボ ル タ ン メ ト リ (C V) 測 定 、 定 電 流 充 放 電 測 定 、 交 流 イ ン ピーダンス測定を行った。 C V 測定は 3 電極系を使用し、 S i 基板上 C N T サンプルを作 用極、(作用極より表面積が非常に大きい量の)活性炭を対極、Ag/Ag+を参照電極 とし、0.7Mテトラエチルアンモニウム/プロピレンカーボネート(PC)溶液に浸し て測定した。サイクリックボルタンメトリ(CV)測定における電圧掃引速度は28mV / s で、 C V 形状を観察し、およそのキャパシタ容量を求めて定電流充放電測定時の充放 電電流量の参考にした。定電流充放電測定において、参照電極Ag/Ag+比+1.0V 充電した際の放電時の傾きからキャパシタ容量を算出しCNT重量によって規格化した。 CNT重量は、A1基板上CNTサンプル重量からA1基板重量を除算して求めた。図1 0 に、 実 施 例 1 に お け る カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 複 合 体 に お い て 、 サ イ ク リ ッ ク ボ ル タン メ トリ評価を行った結果を示す。なお、交流インピーダンス測定では、振幅10mVの交流 電圧を周波数20MHz~0.1Hzで印加することで、電気化学溶液系内での抵抗成分 を分解することが可能になる。イオン抵抗、電子抵抗、拡散抵抗の3成分に分解した。

上記の方法により作成されたカーボンナノチューブ複合体は、CNTの厚さが136μ m であった。また、二層カーボンナノチューブ(以下、 D W N T と称す)の収率は 5 6 % であり、単層カーボンナノチューブ(以下、SWNTと称す)の収率は40%であった。 従って、SWNTとDWNT収率の合計は96%となる。また、容量は97F/gであっ た。

[0058]

(実施例2)

30 実施例1に対し触媒Fe蒸着厚みを1.0nmに変更し、他は同じ条件で実験した(詳 細については、表1参照)。図3に、本実施例に係るDWNTのTEM写真を示す。容量 評価は実施していない。その結果、CNT厚162μm、DWNT収率78%、SWNT 収率8%、SWNT+DWNT収率86%となった。

[0059]

図11に、実施例2におけるカーボンナノチューブ複合体において、透過電子顕微鏡写 真でカーボンナノチューブ100本の外径とその頻度をプロットした結果を示す。これに より、カーボンナノチューブの外径3~7 nm、平均外径4 . 1 nm、分散0 . 4 0 であ ることが分かった。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

40 図12に、実施例2におけるカーボンナノチューブ複合体において、透過電子顕微鏡写 真でカーボンナノチューブ100本の層数とその頻度をプロットした結果を示す。これに より、本実施例に係るカーボンナノチューブ複合体は、二層のカーボンナノチューブが8 0%程度、単層のカーボンナノチューブが10%弱程度の割合であることが分かった。 [0061]

(実施例3)

実施例1に対しCNT合成温度を600 に変更し、他は同じ条件で実験した(詳細に ついては、表 1 参照)。その結果、CNT厚 8 5 μm、DWNT収率 4 4 %、SWNT収 率 5 2 %、 S W N T + D W N T 収率 9 6 % となった。

[0062]

(実施例4)

実施例1に対しCNT合成温度を600 に変更し、加えて触媒Fe蒸着厚みを1.0 nmに変更し、他は同じ条件で実験した(詳細については、表1参照)。容量評価は実施 していない。図4に、一方向に配向したカーボンナノチューブの走査型電子顕微鏡による 断面写真(倍率×10K)を示す。また、図5に一方向に配向したカーボンナノチューブ とアルミニウム基板の走査型電子顕微鏡による断面写真(倍率×40K)を示す。 [0063]その結果、CNT厚153µm、DWNT収率79%、SWNT収率12%、SWNT + D W N T 収率91%となった。 [0064](実施例5) 実施例1に対しCNT合成温度を570 に変更し、加えて触媒Fe蒸着厚みを1.0 nmに変更し、他は同じ条件で実験した(詳細については、表1参照)。 [0065]その結果、CNT厚170µm、容量58F/gとなった。 [0066](実施例6) 実施例1に対し基板をCu箔(10µm厚)に変更し、加えてCNT合成温度を640 度に変更し、他は同じ条件で実験した(詳細については、表1参照)。容量評価は実施し ていない。図6に、一方向に配向したカーボンナノチューブの走査型電子顕微鏡による断 面写真(倍率×10K)を示す。その結果、CNT厚3µmとなった。 [0067](比較例1) 実施例1に対しCNT合成温度を570 に変更し、他は同じ条件で実験した(詳細に ついては、表1参照)。この条件ではCNTは合成されなかったため、その後の評価は実 施していない。 [0068] (比較例2) 現在市販されている電気二重層キャパシタの典型的な電極材料である、A1箔上に塗布 した活性炭電極の電気化学容量を測定し、A1基板上に直接形成したカーボンナノチュー ブ電極との比較を実施した。 [0069] A1箔上に塗布した活性炭電極は、まず活性炭スラリーを作成しA1箔上に塗布するこ とで完成する。始めに、活性炭10g、アセチレンブラック4gをよくかき混ぜ、さらに メチルアルコール40cm³、水100cm³を入れてさらにかき混ぜた。これをホモジ ナイザーで攪拌しながらカルボキシメチルセルロース1.2gを徐々に加え、活性炭スラ リーを作製した。次に、陽極酸化処理したA1箔(箔厚15μm)を、活性炭スラリーに 浸し、引き上げた後、常温で30分、105~で1時間乾燥させた。 [0070]引き続き、このA1箔上活性炭電極を2cm角に切り出し、引き出し電極部の余分な活 性炭部を引っかき除去した後、リードをカシメにより接続した。こうして得たリード付き A 1 箔上活性炭電極 2 本を、その間にビスコースレーヨン製セパレータを介して積層し、 さらに150 で約24時間乾燥させた後、0.7Mテトラエチルアンモニウム/プロピ レンカーボネート(PC)電解液中で減圧下含浸した。

C V 測定は3電極系を使用し、一方のA1 箔上活性炭電極を作用極、もう一方のA1 箔 上活性炭電極を対極、Ag / Ag + を参照電極とし、0.7 Mテトラエチルアンモニウム /プロピレンカーボネート(PC)溶液に浸して測定した。サイクリックボルタンメトリ (CV)測定における電圧掃引速度は28mV/sで、CV形状を観察し、およそのキャ パシタ容量を求めて定電流充放電測定時の充放電電流量の参考にした。 【0072】

50

10

20

30

定電流充放電測定において、参照電極Ag/Ag+比+1.0V充電した際の放電時の 傾きからキャパシタ容量を算出し活性炭重量によって規格化した。その結果、容量61F /gとなった。

[0073]

次に、表2に内部抵抗測定の実験条件と実験結果を示す。

[0074]

【表2】

活物質	陽極/陰極	集電体	電極形成方法	内部抵抗 (Ω)
単層と二層が混在した カーボンナノチューブ	実施例4/実施例6	AI箔	CVD直接成長	0.81
活性炭	比較例4/比較例4	AI箔	ペースト塗布	1.90

[0075]

内部抵抗を測定するために表2に示した電極を用いて2電極系セルを作製し、本発明に 係るカーボンナノチューブ複合体を用いた電極と塗布型活性炭/アルミニウム基板を用い た 電 極 の 内 部 抵 抗 比 較 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 、 本 発 明 に 係 る カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 複 合 体 を用いた電極の方が約50%低いことが判明した。

ここで、図7に、上記実施例において、カーボンナノチューブの合成温度とFe蒸着膜 厚の条件に対し、二層カーボンナノチューブの収率の結果を示す。また、図8に上記実施 例 に お い て 、 カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ 合 成 温 度 と F e 蒸 着 膜 厚 の 条 件 に 対 し 、 単 層 カ ー ボ ン ナノチューブの収率の結果を示す。図9に、上記実施例において、カーボンナノチューブ 合成温度とFe蒸着膜厚の条件に対し、単層と二層カーボンナノチューブの収率を記載し た図を示す。

30 図 7 ~ 図 9 により、触媒層の膜厚が 0 . 5 以上 1 . 0 n m 未満で、かつ、カーボンナノ チューブを気相成長させる合成温度が600 以上660 未満の条件下においては、S WNTとDWNTを合計した割合が、96%、91%、86%と、およそ85~100% の範囲内であることが分かる。

また、触媒層の膜厚が1.0nmの場合は、カーボンナノチューブを気相成長させる合 成温度が570 以上600 未満の条件下においては、SWNTとDWNTを合計した 割合が、およそ90%であることが分かる。

以上の実施例と比較例から判断すると、本発明に係るカーボンナノチューブ複合体を電 極として用いることで従来の電気二重層キャパシタに用いられる活性炭電極よりも高容量 で低抵抗なエネルギーデバイスを提供することが可能である。

【産業上の利用可能性】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

本発明に係るエネルギーデバイスは、大容量な蓄電が可能なため、携帯電話に代表され る無線通信機能を備えた携帯型装置、液晶ディスプレイ等の表示装置、コンピュータ等の 情 報 処 理 端 末 、 自 動 車 や 自 転 車 等 の 輸 送 デ バ イ ス 、 埋 め 込 み 型 人 工 心 臓 等 の 医 療 デ バ イ ス 等におけるエネルギー源又は補助電源として有用である。

[0081]

特に、大電流の放電が可能になったことから、瞬間的なエネルギー消費が激しい携帯電 話に代表される無線通信機能を備えた携帯型装置や、ノートパソコンに代表される情報処

10

20

理端末の動作時間を向上させ、またハイブリッド自動車に代表される輸送デバイスの加速 性能を向上させることができる。 【図面の簡単な説明】 [0082]【図1】本発明に係るカーボンナノチューブ複合体の構成図 【図2】(1)本実施の形態における円筒型エネルギー蓄積デバイス10の外観図(2) 円筒型エネルギー蓄積デバイス10の電極部分の構成図 【図3】実施例2のカーボンナノチューブ複合体における二層カーボンナノチューブの透 過電子顕微鏡によるTEM図 10 【図4】実施例4のカーボンナノチューブ複合体において、一方向に配向したカーボンナ ノチューブの走査型電子顕微鏡による断面図(倍率×10K) 【図5】実施例4のカーボンナノチューブ複合体において、一方向に配向したカーボンナ ノチューブとアルミニウム基板の走査型電子顕微鏡による断面図(倍率×40K) 【図6】実施例6のカーボンナノチューブ複合体において、一方向に配向したカーボンナ ノチューブの走査型電子顕微鏡による断面図(倍率×10K) 【図7】カーボンナノチューブの合成温度とFe蒸着膜厚の条件に対し、二層カーボンナ ノチューブの収率を記載した図 【図8】カーボンナノチューブ合成温度とFe蒸着膜厚の条件に対し、単層カーボンナノ チューブの収率を記載した図 20 【図9】カーボンナノチューブ合成温度とFe蒸着膜厚の条件に対し、単層と二層カーボ ンナノチューブを合計した収率を記載した図 【図10】実施例1におけるカーボンナノチューブ複合体において、サイクリックボルタ ンメトリ評価を行った結果を示す図 【図11】実施例2におけるカーボンナノチューブ複合体において、透過電子顕微鏡写真 でカーボンナノチューブ100本の外径とその頻度をプロットした結果を示す図 【図12】実施例2におけるカーボンナノチューブ複合体において、透過電子顕微鏡写真 でカーボンナノチューブ100本の層数とその頻度をプロットした結果を示す図 【符号の説明】 [0083]30 2 1 カーボンナノチューブ アルミニウム基板 22 円筒型エネルギー蓄積デバイス 1 0 2 a 正極集電体 2 b 負極集電体 3 セパレータ 4 正電極 4 a 上電極 4 b 下電極 5 自 雷 極 40 5 a 上電極 5 b 下電極 7 ガスケット 9 金属製容器 1 1 封口体 12 a 正極リード 12b 負極リード



【図2】



















【図11】















【図6】



フロントページの続き

(72) 発明者 林 茂生 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72)発明者 橋本 泰宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72)発明者 川島 孝啓

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

F ターム(参考) 4G146 AA11 AA12 AB06 AB08 AC02A AC19B AC27A AC30A AD17 AD23

 AD25
 BA12
 BA48
 BB23
 BC09
 BC16
 BC25
 BC33B
 BC42
 BC43

 4G169
 AA03
 AA08
 BB02A
 BB02B
 BC16A
 BC16B
 BC31B
 BC66B
 CB81
 DA06

 EA08
 EB15X
 EB15Y
 EC28
 FA04
 FA05
 FB02
 FB29
 FB44